

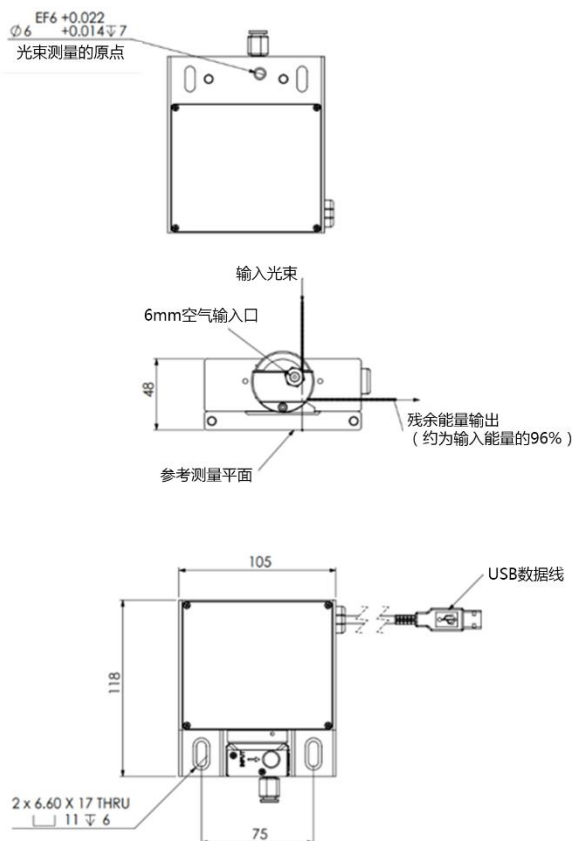
# LAM 光斑分析仪



- 可安装到工作台上进行光斑测量。
- 内置风冷采样器。
- 业内领先的刀口系统
- 特有的图像层析重建算法
- 可测50微米到8毫米范围的光斑
- 精确测量光斑轮廓、功率和位置

## 规格参数

传感器类型	硅基, 使用刀口法测量技术
光谱范围	硅: 350 - 1100 nm, 可联系公司了解其他光谱范围
刀片数	7个刀片, 并使用图像层析重建技术
光斑尺寸范围	50 微米至8 毫米
光斑宽度分辨率	光斑尺寸大于100微米时分辨率为1 微米 光斑尺寸小于100微米时分辨率为0.1 微米
光斑宽度测量精度	±2%
功率范围	最高4 kW (需要衰减片和高压空气风冷, 可能会有一些限制)
功率测量精度	±5%
位置测量精度	± 15 微米
位置分辨率	1微米
测量频率	5 Hz
重量	传感器和电缆共约 1500 克
接口	USB 3.0, windows 7/8/10 (32 & 64 位)
最低硬件要求	CPU i3 1.6 GHz, 4 GB 内存
可选配件	ND 光学衰减片
最低硬件要求	CPU i3 1.6 GHz, 4 GB 内存, Windows 7/8/10



## 订购信息:

LAM-光斑分析仪: 7刀口硅基传感器, 配备高功率衰减片和安装适配器。

DUMA OPTRONICS LTD.

网址: <http://www.dumaoptronics.com>

邮箱: [sales@duma.co.il](mailto:sales@duma.co.il)

2019年4月